

[重新查詢](#)[友善列印](#)**0982學期 課程基本資料**

系所 / 年級	光通系碩專班 1年級	課號 / 班別	78E00046 / A
學分數	3學分	選 / 必修	選修
科目中文名稱	薄膜工程	科目英文名稱	Thin Film Engineer
主要授課老師	游瑞松	開課期間	一學年之下學期
人數上限	20 人	已選人數	18人

起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間

第1週 / 第18週 / I628 / 星期6第06節
第1週 / 第18週 / I628 / 星期6第07節
第1週 / 第18週 / I628 / 星期6第08節

請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

教學綱要

- 本課程將薄膜應用與製程技術將有深入之研究分析與討論。在薄膜製程中，有許多鍍膜製程參數會影響薄膜特性，例如靶材工作功率、反應性氣體分壓比率、工作壓力、基材偏壓、基材溫度、濺鍍距離及沉積時間等，所以製程的最佳化條件需要有系統之研究。對複雜化的製程，將影響因數最大的因素為最優先實驗考量，藉由田口統計設計來制定實驗參數，使得實驗能在最短時間內，作有效可靠的工程判斷的製程條件設計，實驗出鍍膜製程參數最佳化的條件，這是本課程將探討之重點。
- 一、教學目標(Objective)
- 二、先修科目(Pre Course) 無
- 三、教材內容(Outline) 1.真空技術與氣體傳輸安全 2.電漿物理 3.表面動力學與薄膜生長機制 4.薄膜製作技術 5.磊晶生長與光學薄膜 6.表面、界面與元件電性 7.散射與薄膜結構或成分分析 8.薄膜特性檢測技術與原理
- 四、教學方式(Teaching Method) 1.課程講述與實務分析 2.科技論文研讀與討論
- 五、參考書目(Reference) 1.薄膜科技與應用 /羅吉宗 著/ 全華書局

2010/2/24	真空技術與氣體傳輸安全	游瑞松
2010/3/3	真空技術與氣體傳輸安全	游瑞松
2010/3/10	電漿物理	游瑞松
2010/3/17	電漿物理	游瑞松
2010/3/24	論文研讀與報告	游瑞松
2010/3/31	表面動力學與薄膜生長機制	游瑞松
2010/4/7	表面動力學與薄膜生長機制	游瑞松

六、教學進度(Syllabi)	2010/4/14	薄膜製程技術	游瑞松
	2010/4/21	期中考	游瑞松
	2010/4/28	薄膜製程技術	游瑞松
	2010/5/5	磊晶生長與光學薄膜	游瑞松
	2010/5/12	磊晶生長與光學薄膜	游瑞松
	2010/5/19	表面、界面與元件電性	游瑞松
	2010/5/26	表面、界面與元件電性	游瑞松
	2010/6/2	散射與薄膜結構或成分分析	游瑞松
	2010/6/9	論文研讀與報告	游瑞松
	2010/6/16	薄膜特性檢測技術與原理	游瑞松
	2010/6/23	期末考	游瑞松

七、評量方式(Evaluation) 平時成績(40%) + 期中與期末成績(60%)

八、講義位址(<http://>)

九、教育目標

重新查詢

課程查系統 Viewable With Any Browser & 1024 x 768 Resolution

亞洲大學 41354 台中市霧峰區柳豐路500號 TEL: 886 + (0)4 + 2332-3456 FAX: 886 + (0)4 + 2331-6699 © Asia University, Taiwan